

ОТЗЫВ

официального оппонента о диссертационной работе Безбабного Дмитрия Александровича «Исследование формирования, структуры и свойств пленок полупроводниковых силицидов кальция на Si (111)», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников.

Полупроводниковые силициды щелочноземельных металлов в настоящее время привлекают возрастающее внимание исследователей, как с точки зрения получения фундаментальных знаний об их свойствах, так и с целью их практического использования в различных электронных устройствах. Фундаментальный интерес к ним вызван необходимостью изучения механизмов их роста на кремниевых подложках и изучением их оптических, электрических и термоэлектрических свойств, что связано с возможностью изменения их свойств в тонких пленках за счет эффектов напряжения кристаллической решетки и соответствующих изменений в электронной плотности состояний. Практический аспект использования систем с тонкими пленками щелочноземельных силицидов состоит в создании датчиков различных физических величин, включая фотоэлектрические и термоэлектрические преобразователи.

Диссертационная работа Д.А. Безбабного посвящена исследованию процессов формирования, параметров электронной структуры, оптических и электрических свойств тонких (двумерных) и толстых пленок полупроводникового силицида кальция с повышенной концентрацией кремния (Ca_3Si_4), который в отличие от полупроводникового силицида кальция (Ca_2Si) практически не исследован. Известны лишь теоретические работы, которые предсказывают существование такого полупроводникового силицида (Ca_3Si_4) в системе кальций-кремний. Это вызвано узкой областью ее гомогенности и сложностью получения данного силицида при твердофазной эпитаксии. В предварительных экспериментах было обнаружено, что полупроводниковый силицид кальция с составом близким к

Ca_3Si_4 формируется при реактивной эпитаксии из источника кальция на атомарно-чистом кремнии, но диапазон скоростей осаждения кальция, необходимый для его получения, в настоящее время не исследован. Соответственно, не разработаны способы, позволяющие выращивать пленки данный силицида различной толщины. Предварительная подготовка поверхности путем формирования слоя аморфного кремния или Mg_2Si может изменить кинетику формирования силицидов кальция (Ca_3Si_4 или Ca_2Si) и последовательность образуемых фаз. Этот подход в настоящее время также не исследован. Не исследуемым остается вопрос роста кремния поверх данных силицидов. Решение этой проблемы позволит подойти к созданию гетероструктур $\text{Si}/\text{Ca}_3\text{Si}_4/\text{Si}(111)$ и $\text{Si}/\text{Ca}_2\text{Si}/\text{Si}(111)$, которые могут обладать интересными фотоэлектрическими и термоэлектрическими свойствами.

В диссертационной работе Д.А. Безбабного анализируются также и процессы формирования двойных гетероструктур $\text{Si}/\text{Ca}_2\text{Si}/\text{Si}(111)$ и $\text{Si}/\text{Ca}_3\text{Si}_4/\text{Si}(111)$, проведены исследования полученных структур, их оптических, электрических, термоэлектрических и фотолюминесцентных свойств.

Результаты исследований свидетельствуют в пользу накопления фундаментальных знаний о системе Ca-Si и развития тонкопленочных кремниевых технологий в целом, поэтому актуальность и важность диссертационной работы Д.А. Безбабного не вызывает сомнений.

Работа состоит из введения, пяти глав, заключения и списка цитируемой литературы, содержит 126 страниц машинописного текста, 55 рисунков и список цитируемой литературы из 77 наименований.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, формулируются цель и задачи диссертационной работы, ее научная новизна и практическая ценность, изложены основные защищаемые положения и описана структура диссертации.

В первой главе приводится обзор теоретических и практических результатов особенностей формирования, структуры и свойств силицидов щелочноземельных металлов, их зонной энергетической структуры, а также

рассмотрены процессы формирования и свойства гетероструктур со встроенным полупроводниковыми силицидами хрома, железа и магния на кремниевых подложках.

В соответствии с направлением дальнейшего исследования автором собраны и представлены в первой главе сведения о механизмах и условиях формирования полупроводниковых силицидов кальция на поверхностях кремния с ориентацией (111).

Вторая глава посвящена краткому изложению методов, использованных в данной диссертационной работе (ЭОС, ХПЭЭ, ПЭМ, АСМ, оптической спектроскопии, спектроскопии комбинационного рассеяния света, дифференциальной отражательной спектроскопии (ДОС) и фотолюминесцентной спектроскопии). В главе приведены, методы очистки образцов, расчетов скоростей осаждения, расчета оптических функций из спектров ДОС.

В третьей главе представлена общая схема ростовых экспериментов по формированию силицидов Ca_2Si и Ca_3Si_4 . По данным ЭОС и ХПЭЭ показано, что формирование нанокристаллической пленки силицида кальция с составом Ca_2Si , наблюдается при температуре 130 °C в процессе как осаждения на предварительно сформированный слой аморфного кремния, так и на тонкую пленку Mg_2Si . При осаждении Са на слой Mg_2Si происходит выход части атомов магния на поверхность образца и формирование сплошного слоя Ca_2Si . Показано, что Ca_2Si , сформированный обоими способами, по данным оптической спектроскопии является непрямозонным полупроводником с шириной запрещенной зоны 0,68–0,70 эВ, состоит из наноразмерных зерен, характеризуется КРС-пиком 352 cm^{-1} с малой интенсивностью, что подтверждает малый объем наноразмерных зерен в структуре пленки.

Исследование кристаллической структуры путем расчета картины ПМД позволило установить, что выращенная пленка состоит из поликристаллических зерен со структурой Ca_3Si_4 .

Методом оптической спектроскопии и температурных исследований сопротивления в широком диапазоне температур определено, что оба типа пленок (Ca_2Si и Ca_3Si_4) имеют непрямую запрещенную зону с шириной 0,63 эВ для Ca_3Si_4 и 0,68–0,70 эВ для Ca_2Si . Показано, что высокая прозрачность пленок Ca_2Si наблюдается во всем диапазоне энергий от 1,0 до 0,1 эВ, а для пленок Ca_3Si_4 наблюдается интенсивное поглощение в области энергий ниже края фундаментального поглощения (0,6–0,1 эВ), что связано с плазменным отражением при высокой концентрации свободных носителей в Ca_3Si_4 .

В четвертой главе исследован рост кремния поверх наноразмерных островков и двумерной фазы силицидов кальция Ca_2Si и Ca_3Si_4 , а также их оптические свойства. Установлено по данным АСМ, что в зависимости от толщины осажденного слоя кальция в ДГС формируются нанокристаллиты или сплошной слой Ca_3Si_4 , а рост кремния сопровождается выходом части нанокристаллов Ca_3Si_4 на поверхность. Это приводит к появлению интенсивных пиков КРС от пленки Ca_3Si_4 (344 , 389 и 416 см^{-1}), которые по положению хорошо совпадают с пиками для незакрытых пленок Ca_3Si_4 .

Результаты спектроскопии КРС для образцов, выращенных методом МЛЭ кремния с различными толщинами осажденного Са (76, 30 и 3 нм) показали наличие двух КРС-пиков с максимальной интенсивностью (389 и 416 см^{-1}) и с малой интенсивностью (344 см^{-1}). Результаты исследования КРС микроскопии для этих значений КРС-сдвигов показали, что оба интенсивных пика соответствуют только одной формируемой фазе (Ca_3Si_4) в выращенных гетероструктурах.

К основным результатам диссертационной работы, имеющим научную и практическую значимость, можно отнести следующее:

1. Установлено, что формирование нанокристаллической пленки силицида кальция с составом Ca_2Si наблюдается при температуре 130°C в процессе как осаждения на предварительно сформированный слой аморфного кремния, так и на тонкую пленку Mg_2Si . Осаджение кальция методом реактивной epitаксии на Si (111) 7×7 подложку при 500°C приводит к формированию

поликристаллического полупроводникового силицида кальция с кристаллической структурой, отличной от пяти известных силицидных фаз (Ca_2Si , CaSi , Ca_5Si_3 , $\text{Ca}_{14}\text{Si}_{19}$, CaSi_2), что по мнению автора, позволяет ее отнести к гексагональной решетке Ca_3Si_4 .

2. Методами оптической спектроскопии установлено, что пленки Ca_2Si и Ca_3Si_4 обладают непрямым фундаментальным переходом: $E_g = 0,68$ эВ и $E_g = 0,63$ эВ, соответственно. Анализ данных модуляционной оптической спектроскопии, полученных при комнатной температуре, показал существование прямых межзонных переходов при 0,89 эВ и 0,912 эВ с большой силой осциллятора в толстых пленках Ca_3Si_4 и отсутствие подобных прямых межзонных переходов в пленках Ca_2Si .

3. Доказано, что два интенсивных КРС-пика 389 см^{-1} и 416 см^{-1} и слабый КРС-пик 344 см^{-1} относятся только к одной силицидной фазе. В пленках Ca_2Si замечен только слабый пик при 352 см^{-1} , что подтверждает слабую кристаллизацию выращенных пленок.

4. Установлено, что пленка Ca_3Si_4 сохраняет свой состав во время отжига при 500°C в течение 30 минут, а для пленок Ca_2Si при 30-минутном отжиге при 130°C наблюдается частичное разложение силицидной фазы.

5. В пленках Ca_3Si_4 обнаружено формирование плазменного минимума в спектрах отражения при энергиях 0,8–0,1 эВ, что доказывает наличие в них высокой плотности свободных носителей, которые по данным метода горячего зонда являются электронами.

6. Впервые в двойных гетероструктурах $\text{Si}/\text{Ca}_3\text{Si}_4/\text{Si}(111)$ при 5 К обнаружена слабая фотолюминесценция в диапазоне энергий фотонов 0,9–1,0 эВ. Установлено, что в зависимости от толщины осажденного слоя кальция в двойных гетероструктурах формируются нанокристаллиты или сплошной слой Ca_3Si_4 , а рост кремния сопровождается выходом части нанокристаллитов Ca_3Si_4 на поверхность.

7. Рост слоя кремния при 100°C толщиной 48 нм поверх тонкого слоя Ca_2Si приводит к встраиванию слоя силицида в монокристаллический кремний на

глубину до 20 нм по данным поперечных срезов ПЭМ с высоким разрешением, что соответствует формированию двойной гетероструктуры а- $\text{Si}/\text{Ca}_2\text{Si}/\text{Si}(111)$ со встроенным слоем Ca_2Si .

8. Поперечный электрический транспорт в двойных гетероструктурах со встроенным слоем Ca_2Si , выращенном на прекурсоре Mg_2Si , обусловлен растворением атомов магния в кремнии на глубину до 1,5 мкм и появлением донорных уровней магния с энергией активации 240 мэВ и плотностью до $7,3 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-2}$.

Достоверность научных результатов заключается в последовательном и корректном применении современных методов анализа морфологии и структуры поверхности, методов исследования фазового состава и электронной структуры, оптических и электрических свойств выращиваемых нанообъектов и их согласованности с результатами работ других исследовательских групп.

Новизна результатов не вызывает сомнений и подтверждается публикациями диссертанта. По теме исследования автором опубликовано 10 работ, 5 из которых в журналах, входящих в перечень изданий ВАК РФ.

Данная работа делает вклад в развитие отдельных вопросов физики полупроводников, поскольку в ней выполнены систематические исследования способов формирования и полупроводниковых свойств низкоразмерного силицида кальция в кремниевой матрице, имеющие заметное значение для дальнейшего развития кремниевой гетероэлектроники.

Среди недостатков работы можно отметить следующие:

- не выполнен расчет оптических функций n и k по результатам измерений ДОС спектров

- не получены картины ДМЭ для фазы силицида Ca_3Si_4

Однако эти замечания ни в коей мере не оспаривают достоверность полученных в диссертационной работе результатов, которые имеют приоритетный характер, и не уменьшают ее ценность, учитывая объем

проделанной работы и достаточное количество экспериментальных сведений по формированию и полупроводниковым свойствам низкоразмерного силицида кальция и наногетероструктур на его основе.

Представленный автореферат достаточно полно отражает содержание диссертации. Текст диссертации написан ясно и лаконично. Работа прошла серьезную апробацию, основные результаты диссертации были изложены на международных и российских конференциях. Объем и оформление диссертации не вызывает замечаний.

Считаю, что по актуальности, новизне, уровню, объему и научной значимости полученной информации настоящая диссертационная работа удовлетворяет всем требованиям Положения ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Безбабый Дмитрий Александрович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников.

Официальный оппонент д.х.н.

18 февраля 2014 г.

С.Л. Синебрюхов

Подпись С.Л. Синебрюхова, д.х.н., с.н.с. ИХ ДВО РАН удостоверяю.

Ученый секретарь ИХ ДВО РАН, к.х.н.

Д.В. Маринин

